文章编号: 1006-4710(2013)04-0444-06

红光 OLED 空穴注入层 2-TNATA 工艺及其性能研究

袁进, 安涛, 夏艳峰

(西安理工大学自动化与信息工程学院,陕西西安710048)

摘要: 采用真空热蒸镀的方法在高精度膜厚控制仪的监控下,对多层红光 OLED 空穴注入层 2-TNATA 有机薄膜蒸镀工艺的条件及厚度对器件的发光性能进行实验研究。实验表明制备理想的 2-TNATA 薄膜工艺条件为,基板与蒸发源距离为 24 cm,束源炉蒸发孔径为 1.5 mm,基片温度为 50℃,蒸镀温度为 230℃,具有空穴注入层器件较无此层器件的发光性能得到显著提高,其空穴注 入层最佳厚度为 20 nm。该器件在 12 V 电压下亮度从 1800 cd/m² 提高到 7600 cd/m²,提高了 4 倍,发光效率从 1.8 cd/A 提高到 2.6 cd/A,提高了 1.4 倍,光谱峰值为 618 nm。 关键词: 红光 OLED; 空穴注入层; 2-TNATA; 工艺

中图分类号: TN383 文献标志码: A

Technology and Performance Research of Red OLED Hole Injection Layer 2-TNATA

YUAN Jin, AN Tao, XIA Yanfeng

(Faculty of Automation and Information Engineering, Xi' an University of Technology, Xi' an 710048, China) **Abstract**: This paper adopts vacuum thermal evaporation method, under the monitoring of highly accurate film thickness controller, the multi-layer red light OLED hole injection layer 2-TNATA organic thin film deposition process conditions and the thickness on the luminous performance to carry out the experimental research. The results of experiments show that : the distance between the substrate and the evaporation source is 24 cm; beam source furnace evaporation diameter is 1.5 mm; substrate temperature is 50° C; and the evaporation temperature is 230° C for the preparation of the ideal 2-TNATA thin film process conditions; Device with hole injection layer than those without this layer luminescence performance is significantly improved; its best hole injection layer thickness is 20 nm. This device brightness under the 12 V voltage increased from 1800 cd/m² to 1800 cd/m², raised by four times; the luminous efficiency from 1.8 cd/A up to 2.6 cd/A, increased by 1.4 times, and the spectral peak is at 618 nm. **Key words**: red OLED; hole injection layer; 2-TNATA; technology

有机电致发光器件的相关研究初始于 19 世纪 60 年代,直到 80 年代末 OLED 才蓬勃发展起来^[1]。 OLED 具有全固态、低压驱动、主动发光、响应快速、 宽视角、发光面积大、发光波长覆盖整个可见光区以 及色彩丰富等优点^[25],在实现全色大面积显示领 域具有很大的优势,成为极具前景的平板显示器件。 有机电致发光器件的发光亮度正比于空穴和电子的 浓度及激子的复合概率的乘积,想要获得较高的发 光效率,不仅需要空穴和电子能够有效注入、传输及 复合且要求空穴和电子注入达到平衡^[6]。因此,在 有机电致发光器件中,有机层之间及有机层与两电 极的能带匹配对器件复合发光非常重要。

常用的空穴注入层材料为 CuPc、星状的 arylamines 如 TNATA 和 polyaniline、高分子材料 PEDT: PSS。由于 CuPc 容易与空穴传输材料分相,如制作 的 CuPc(10 nm)/TPD 或 NPB(50 nm)的薄膜经 80℃热处理后生成树枝状结晶。目前广泛使用的空 穴材料为星状的 arylamines。

收稿日期: 2013-08-26

基金项目:陕西省教育厅专项科研计划基金资助项目(08JK374)。

作者简介: 袁进, 男, 硕士生, 研究方向为新型半导体 OLED 平板显示技术与照明。E-mail: dhyyj1314@163.com。安涛, 男, 副教授, 研究方向为新型功率半导体器件、新型半导体 OLED 平板显示技术与照明。E-mail: antao@ xaut. edu. cn。

空穴注入层是连接空穴传输层与阳极 ITO 的桥 梁,合理的选择空穴注入层材料及工艺参数可以帮 助改善器件性能。本研究主要研究空穴注入层 2-TNATA 蒸镀工艺及其厚度对多层红光 OLED 发光 性能的影响,通过实验对器件发光特性进行测试与 分析,最终得到其最佳工艺参数和理想薄膜厚度。

1 实验

实验使用科特真空机电设备厂生产的高真空有 机/金属热蒸发镀膜设备,利用高精度石英晶体膜厚 控制仪严格控制有机薄膜厚度以及有机材料蒸镀速 率以实现 OLED 器件制备。为研究红光 OLED 空穴 注入层 2-TNATA 蒸镀工艺及其性能,实验采用典型 ITO/2-TNATA(X nm)/NPB(30 nm)/Alq3: DCJTB (50 nm,3%)/Alq3(30 nm)/LiF(0.8 nm)/Al(100 nm)的多层红光 OLED 器件结构,其器件结构和能 级结构如图 1 所示。实验对不同空穴注入层 2-TNATA 膜厚的器件进行了制备及发光性能测试,分 析研究不同空穴注入层 2-TNATA 膜厚对器件光电 性能的影响。



图 1 红光 OLED 器件结构及能级结构 Fig. 1 Red OLED device structure and level structure

1.1 器件的制备

实验样品面积为 20 mm × 20 mm,方块电阻为 25Ω/口平整的 ITO 玻璃作为阳极基片。为了保证 真空蒸镀有机膜品质,首先用丙酮将 ITO 玻璃表面 进行清洗、进行掩膜和 ITO 图形刻蚀、对 ITO 玻璃依 次进行去离子水、无水乙醇、丙酮超声清洗各 10 ~ 20 min、最后进行高温烘干以备待用,真空蒸镀装片 前用高纯 N2 对 ITO 玻璃进行吹洗。

在 OLED 器件样品实验制备过程中,基板与蒸

发源垂直距离为 24 cm,衬底温度为 50 ℃,蒸镀腔 体真空度保持在 5×10⁻⁵ Pa 左右,并分别将有机材 料放在可由温度单独控制的蒸发源(石英舟)中,按 照如表 1 所示的真空蒸镀工艺参数及条件进行有机 层的蒸镀^[79]。其中,掺杂采用束源炉双源共同蒸 镀技术,将所用的材料分别放在两个不同的石英坩 埚中,通过单独控制每个蒸发源的温度控制材料的 蒸镀速率,最终获得所需的掺杂浓度,按设计的器件 结构分别生长不同的功能层。

表1 真空热蒸镀条件及工艺参数

ition process parameters and conditions

	14.5.1	rus. r vuotum deposition process parameters and conditions					
有机材料	NPB	Alq3: DCJTB	Alq_3	材料	LiF	Al	
束源炉孔径/mm	1.5	2.0:1.0	2.0	电流/A	40	50	
束源炉温度/℃	110	135:110	135	电压/V	0.55	0.90	
有机层膜厚/nm	30	50	30	膜厚/nm	0.8	100	
蒸镀速率/(nm/s)	0.13	0.25:0.013	0.25	蒸镀速率/(nm/s)	0.08	0.155	

1.2 空穴注入层 2-TNATA 的工艺

空穴注入层的引入可以降低空穴注入势垒高度,有效改善载流子注入效果,降低器件启亮电压, 提高器件发光性能。本研究针对空穴注入材料 2-TNATA 有机薄膜的蒸镀工艺条件对蒸镀速率的影 响进行实验分析研究。最后得到满足红光 OLED 器 件空穴注入层 2-TNATA 有机薄膜制备温度、基板温 度、蒸发源与基板距离、束源炉的蒸镀孔径等工艺条 件。在基板与蒸发源垂直距离为 24 cm、基片温度 为 50 ℃、束源炉蒸发孔径为 1.5 mm、蒸镀腔体真空 度为 5×10⁻⁴ Pa 条件下,2-TNATA 有机薄膜蒸镀速 率随温度变化如图 2 所示。



图 2 空穴注入材料 2-TNATA 的蒸镀速率随温度变化 Fig. 2 The hole injection material 2-TNATA deposition rate varies with temperature

有机电致发光二极管,有机薄膜的蒸镀速率 (蒸发温度)是决定薄膜质量和厚度的重要参数,所 以有效控制有机材料蒸镀速率不仅可提高成膜质量 得到高性能器件,还可精准控制厚度以利于获得合 适的器件特性参数。因此,一般有机半导体材料的 蒸镀速率要控制在0.01~0.5 nm/s,生长的有机薄 膜才能满足器件的要求^[10-13]。从图2可以看出,空 穴注入材料 2-TNATA 的蒸镀速率随温度增加迅速 增大,温度 210 ℃~250 ℃时蒸镀速率从 0.043 nm/s增加到 0.39 nm/s。温度为 210 ℃~235 ℃较 低部分,蒸镀速率随温度变化较小,其变化率仅为 5.48×10⁻³ nm/s。温度 235 ℃~250 ℃较高部分蒸 镀速率变化率为0.014 nm/s。在蒸镀有机薄膜时蒸 镀温度选取太低,虽然生长的有机薄膜厚度易于控 制、膜致密,但是蒸镀时间较长,不利于器件的工业 制备生产。蒸镀温度选取过高,生长的有机薄膜厚 度难以控制、膜质量差,不利于提高器件的光电性 能。所以一般 2-TNATA 的蒸镀温度为 225 ℃~ 235 ℃较为合适,其蒸镀速率为0.15~0.2 nm/s,并 且速率变化随温度变化比较平缓,此时束源炉温度 的细微变化不会引起沉积速率的大幅度改变,可以 认为在该温度下的有机薄膜是匀速生长的。本实验 洗取空穴注入材料 2-TNATA 蒸镀温度为 230 ℃,蒸 镀速率0.16 nm/s,通过控制其蒸镀时间制备所需 薄膜厚度。

2 结果与讨论

实验制备6组未封装不同空穴注入层厚度的多 层红光 OLED 器件,发光面积约为 10 mm×10 mm。 在室温(300 K)、大气环境下,使用 JWC-30C 型直 流电源、OMNI—λ 型光谱仪等仪器,对器件的电流 密度-电压(*J-U*)特性、发光亮度-电压(*L-U*)特性、 器件发光效率、电致发光(*EL*)光谱等光电特性进行 了测量,并分析其器件特性变化原因。

2.1 器件的电流密度-电压(J-U)特性

对有机电致发光器件而言,引入空穴注入层,可 以降低空穴注入势垒,提高空穴的注入能力,器件的 电流也随之改变,不同空穴注入层厚度下器件的电 流密度-电压(*J-U*)特性曲线如图 3 所示。



图 3 不同空穴注入层厚度下器件电流随电压变化 Fig. 3 The device *J-U* characteristic at each hole injection layer thickness

从图3可以看出,引入空穴注入层后器件的电 流比没有空穴注入层有所提高。由图1中的器件能 级结构可以得知, NPB 和 ITO 的 HOMO 能级差为 0.7 eV, 而 2-TNATA 和 ITO 的 HOMO 能级差为 0.3 eV,2-TNATA的引入降低了空穴注入势垒,更容易 将空穴从阳极进入到空穴传输层 NPB,从而提高了 器件的电流。在 J-U 曲线中随电压增大,不同空穴 注入层厚度器件的电流增大,当空穴注入层厚度为 5~20 nm 时器件的电流随着空穴注入层厚度的增 加而增大,当其厚度达到20 nm 时电流达到最大;当 空穴注入层厚度大于20 nm 时电流随着空穴注入层 厚度增加而减小。这是由于空穴注入层厚度比较薄 时形成的有机薄膜表面较粗糙,与 ITO (Indium Tin Oxide)阳极结合不好,甚至存在未沉积到的斑点。 随着空穴注入层厚度的增加,薄膜与ITO结合良好, 形成致密、均匀的 2-TNATA 薄层^[12],改善空穴的注 入能力,因此,电流会随着薄层厚度的增加而增大。 然而,当空穴注入层厚度增加到一定程度时,空穴被 大量的注入到空穴传输层 NPB 中,由于电子-空穴 的注入不平衡,使得大量的空穴积聚在空穴传输层 与发光层(NPB/Alg₃:DCJTB)界面,最终在有机层 中积累空间电荷,形成内建电场,其相反电场导致空 穴的漂移速度降低,从而使得器件的电流密度变 小^[14],从而影响了器件的发光效率。此时,随着空 穴注入层 2-TNATA 厚度的增加器件发光效率会减 小。可以看出,当在典型的多层红光 OLED 器件中. 空穴注入材料 2-TNATA 的薄膜厚度约为 20 nm 时, 其电流最大,器件的空穴注入层厚度较为理想。

2.2 器件的发光亮度-电压(L-U)特性

有机薄膜电致发光器件是载流子(电子和空 穴)在外加电压所形成的外电场作用下分别从阳极 和阴极注入到有机材料层中,部分电子和空穴相遇、 复合形成激子,激子在有机发光层中以辐射衰减的 方式释放能量时便发光,因此想要得到高亮度的器 件,应使得较多数量的空穴和电子载流子注入到发 光层。引入合适厚度的空穴注入层可以增大空穴从 ITO 注入到有机材料的注入数量,提高器件的发光 亮度,降低器件的启亮电压。不同空穴注入层厚度 下器件的发光亮度随电压变化测试结果如图 4 所示。



图 4 不同空穴注入层厚度下器件发光亮度随电压变化 Fig. 4 The device luminance-voltage characteristic at each hole injection layer thickness

从图4曲线可以看出,随着空穴注入层厚度从 0 nm 增加到 25 nm,在 12 V 电压下器件的发光亮度 分别为1800 cd/m²、4000 cd/m²、5300 cd/m²、6700 cd/m²、7600 cd/m² 以及 4600 cd/m²,发光亮度随着 2-TNATA 的厚度的增加表现为抛物线趋势。当 2-TNATA 的厚度为0~20 nm 时,随着空穴注入层厚 度的增加器件的亮度增大;当2-TNATA的厚度为20 nm时,器件发光亮度达到7600 cd/m² 为最大;当空 穴注入层厚度继续增加时,亮度随着空穴注入层厚 度增加反而减小。其原因是随着空穴注入层材料 2-TNATA 的引入,降低了空穴的注入势垒,使得较 多空穴能够更加容易的通过 2-TNATA/NPB 的内表 面到达空穴传输层 NPB 中;另一方面,由图 1 器件 所用材料的能级结构示意图可知,2-TNATA 与 NPB 之间的 LUMO 能级差为 0.2 ev, 该能级差可以有效 阻挡电子,减小器件中电子形成的漏电流,这两个方 面的因素保证了红光 OLED 器件中的空穴和电子载 流子被有效地注入到有机发光层中形成较大数目的 激子,从而能够增加发光层中载流子的复合数量,提 高发光亮度。然而,器件中空穴注入层薄膜厚度不 能过厚,否则会引起载流子注入不平衡,导致空穴在 NPB/Alq,:DCJTB 界面的积累,从而形成内建电场。 此外,积累的空穴还会形成漏电流,内建电场与空穴 漏电流的形成导致载流子复合效率与发光效率降低,从而影响器件的光电性能。

2.3 器件的发光效率

有机电致发光器件的效率 η 是单位电流密度 下所能发出的光的强度,通常用来衡量能量利用率, 其基本关系式为:

$$\eta = B/J \tag{1}$$

其中,B为发光亮度,J为相应发光区的电流密度。

将实验制备的发光面积为 10 mm × 10 mm 的红 光器件样品进行了测试。在施加 12 V 固定电压下, 其发光效率随着不同空穴注入层厚度的变化趋势如 图 5 所示。



图 5 电压为 12 V 时各器件发光效率 Fig. 5 The device luminescence efficiencies at 12 V

从图 5 可以看出,随着空穴注入层厚度从 0 nm 增加到 25 nm,在 12 V 电压下器件的发光效率分别 为 1.8 cd/A、2.1 cd/A、2.3 cd/A、2.7 cd/A、2.6 cd/A、2.2 cd/A,器件发光效率随着空穴注入层厚 度的增加呈现抛物线趋势。当空穴注入层 2-TNA-TA 厚度从 0 nm 增加到 15 nm 时,发光效率随着空 穴注入层厚度的增加而增大,当其厚度为 15 nm 时 器件发光效率达到 2.7 cd/A 为最大,然后其效率随 着空穴注入层厚度增加反而减小。

从器件的特性参数测试结果可以看出,空穴注 入层厚度对器件的亮度、伏安特性、发光效率 η 以 及启亮电压等特性参数影响很大。薄膜厚度在 20 nm时,器件的发光亮度为 7600 cd/m²、发光效率 η为2.6 cd/A、启亮电压为6 V、最大工作电压为 13 V,器件光电性能得到明显改善。最后通过综合考 虑,在典型的多层红光 OLED 器件中,选取空穴注入 材料 2-TNATA 蒸镀温度为 230 ℃,其蒸镀速率 1.60 nm/s,薄膜厚度选取 20 nm 左右较为理想。实 验制备器件所得的发光实物图与光谱图见图 6。光 谱峰值为 618 nm,光谱的半峰全宽较窄,同时光谱 范围相对集中,表明在此结构下器件的发光效率比 较高。



图 6 红光 OLED 发光与光谱 Fig. 6 Red OLED luminescence and spectroscopy

3 结 论

1) 对空穴注入层材料 2-TNATA 的蒸镀工艺进 行了实验研究。在蒸发源与基板的垂直距离为 24 cm,束源炉口径为1.5 mm,基板温度保持 50 ℃,蒸 发温度为 230 ℃、蒸镀速率为 0.16 nm/s 时,通过控 制蒸镀时间可为红光 OLED 器件提供一种与 ITO 结 合良好,薄厚均匀、致密的 2-TNATA 理想厚度的空 穴注入层薄层。

2) 实验研究了 2-TNATA 的厚度对多层红光 OLED 光电性能的影响。在 OLED 器件结构中引入 2-TNATA 空穴注入层后,不仅降低了空穴的注入势 垒,提高空穴注入能力,而且还可作为阳极与空穴传 输层之间的缓冲层降低陷阱与缺陷形成,提高空穴 注入效率,使得器件发光性能得以改善。

3) 2-TNATA 厚度选取理想的 20 nm 时,器件启 亮电压与最大工作电压分别为6 V、13 V;在12 V 驱 动电压下,器件发光亮度从 1 800 cd/m² 增加到 7 600 cd/m²,提高了 4 倍多;发光效率从 1.8 cd/A 增加到 2.6 cd/A,提高了 1.4 倍;得到波长为 618 nm 发光性能明显改善的 OLED 红光器件。

参考文献:

[1] 王英连,曾仁芬. 有机电致发光器件的回顾及展望[J]. 光机电信息, 2009, 26(5):16-22.

Wang Yinglian, Zeng Renfen. Review development of organic light emitting device [J]. OME Information, 2009, 26 (5):16-22.

- [2] Jia Yong, Deng Zhenbo, Xiao Jing, et al. The effect of pbd as electron transporting layer in AIq₃: DCJTB organic light emitting devices [J]. Chinese Journal of Luminescence, 2008,29(1):23-26.
- [3] Han Shiliang, Yuan Yongbo, Lian Jiarong, et al. The effects of ITO anode resistance on OLEDs performance[J].

Chinese Journal of Luminescence ,2008,29(3):429-432.

- [4] Thomschke M, Nitsche R. Optimized efficiency and angular emission characteristics of white top-emitting organic electroluminescent diodes [J]. Applied Physics Letters, 2009,94:083303-083305.
- [5] 崔国宇,李传南,李涛,等. 采用 Li₃N n 型掺杂层作为电子注入层的 OLED 器件研究[J]. 光子学报,2011,40 (2):194-198.
 Cui Guoyu, Li Chuannan, Li Tao, et al. Organic light-e-mitting device with Li₃N n-type doped electron injecting layer[J]. Acta Photonica Sinica, 2011, 40(2): 194-198.
- [6] 牟强,王秀峰,张麦丽. 空穴缓冲层 2T-NATA 厚度对 OLED 器件性能的影响[J]. 液晶与显示,2008,23(6): 680-683.

Mu Qiang, Wang Xiufeng, Zhang Maili. Effect of hole buffer layer 2T-NATA thickness on OLED performances [J]. Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays, 2008,23(6):680-683.

- [7] 安涛,夏艳峰,南晶彪,等.发光层掺杂对红光 OLED 性能影响研究[J].光子学报,2013,42(1):24-27.
 An Tao, Xia Yanfeng, Nan Jingbiao, et al. Hole injection layer effect on red OLED performance[J]. Acta Photonica Sinica, 2013, 42(1): 24-27.
- [8] 郭闰达, 王鹏, 陈宇, 等. 一种改善红光顶发射 OLED 色
 纯度及角度依赖特性的方法研究[J]. 光子学报, 2013, 42(1):1-5.
 Guo Runda, Wang Peng, Chen Yu, et al. A method for

improving the color purity and angle-dependent character of red top-emitting organic light-emitting device [J]. Acta Photonica Sinica, 2013, 42(1): 1-5.

- [9] Ma Fengying, Su Jianpo, Cheng Dongming , et al. High efficiency high brightness red emission microcavity organic light-emitting diodes [J]. Acta Photonica Sinica, 2007, 36 (8):1397-1399.
- [10] 姚宁,李全友,王英俭,等. LiF 对柔性有机电致发光器 件性能的影响[J].人工晶体学报,2009,38(2):

450-454.

Yao Ning, Li Quanyou, Wang Yingjian, et al. Impact to flexible organic light emitting devices of LiF [J]. Journal of Synthetic Crystals, 2009,38(2): 450-454.

[11] 贾许望,关云霞,牛连斌,等. ZnO 空穴缓冲层对 OLED 性能的影响[J]. 重庆师范大学学报,2012,29(2): 72-76.

Jia Xuwang, Guan Yunxia, Niu Lianbin, et al. Influence of hole buffer layer ZnO on properties of organic light-emitting devices [J]. Journal of Chongqing Normal University, 2012, 29(2):72-76.

- [12] Chen Shifang, Wang Chingwu, Wang Guojing, et al. Influence of the injection layer on the luminescent performance of organic light- emitting diodes[J]. Applied Physics Letters, 2004, 85(5):765-767.
- [13] 李峰,梅桢,张卫华,等. CaF₂ 包覆 Zn₂SiO₄:Mn⁺₂ 绿色 荧光粉的发光性能研究 [J]. 西安理工大学学报, 2013,29(1):61-65.
 Li Feng, Mei Zhen, Zhang Weihua, et al. Luminescent characterization of CaF₂-coated Zn₂SiO₄:Mn⁺₂ phosphors [J]. Journal of Xi' an University of Technology, 2013,29 (1):61-65.
- [14] 张代顺, 张旭, 钱可元,等. 空穴缓冲层 CuPc 对有机电 致发光器件特性的影响[J]. 半导体学报, 2005, 26 (1):78-82.

Zhang Daishun, Zhang Xu, Qian Keyuan, et al. Influence of hole buffer layer CuPc on properties of organic light-emitting devices [J]. Chinese Journal of Semiconductors ,2005,26(1):78-82.

(责任编辑 李虹燕)

(上接第420页)

- [13] Li Y, Gao W, Ci L, et al. Catalytic performance of Pt nanoparticles on reduced graphene oxide for methanol electro-oxidation[J]. Carbon, 2010, 48 (4): 1124-1130.
- [14] Yu S, Liu Q, Yang W, et al. Graphene-CeO₂ hybrid support for Pt nanoparticles as potential electrocatalyst for direct methanol fuel cells [J]. Electrochimica Acta, 2013, 94: 245-251.
- [15] Marcano D C, Kosynkin D V, Berlin J M, et al. Improved snthesis of gaphene oide [J]. ACS Nano, 2010, 4(8): 4806-4814.
- [16] Xu C, Wang X, Zhu J W. Graphene metal particle nanocomposites [J]. Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112(50): 19841-19845.
- [17] Sharma S, Ganguly A, Papakonstantinou P, et al. Rapid

mcrowave snthesis of CO tolerant reduced graphene oxidesupported platinum electrocatalysts for oxidation of methanol [J]. Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114 (45):19459-19466.

- [18] Wietecha M S, Zhu J, Gao G H, et al. Platinum nanoparticles anchored on chelating group-modified graphene for methanol oxidation [J]. Journal of Power Sources, 2012, 198: 30-35.
- [19] Han X X. Influence of rare earths on activity and selectivity of hydrogenation of chloronitrobenzene over PtM/C (M = La, Ce, Pr, Nd and Sm) catalysts [J]. Indian Journal of Chemistry, 2009, 48(2): 168-172.

(责任编辑 李虹燕)